特許協力条約

発信人	日本国特許厅	(国院調宜機関)	İR
出願人代	————— <del>沈</del> 理人		]
			1 Y

REC'D 2 1 APR 2005

あて名

〒 100-0005

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 PCT 国際調査機関の見解費 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]

**務所** 発送

<sup>発送日</sup> (日. 月. 年) 19. 4. 2005

今後の手続きについては、下記2を参照すること。 出願人又は代理人 151515-248 の勘類記号 優先日 国際出願日 国際出願番号 (日.月.年) 26, 12, 2003 (日.月.年): 24. 12. 2004 PCT/JP2004/019417 国際特許分類(IPC) H01L21/027, G03F7/30 Int. Cl 出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社

_		この日知事はその内容	なた今す。
l	1.	この見解書は次の内容 ※ 第 1 欄	見解の基礎
			優先権
l		第皿概	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
l		第Ⅳ概	発明の単一性の欠如
١		※ 第Ⅴ概	PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを裏付けるための文献及び説明
١		第VI欄	ある種の引用文献
١		☐ 第VII概	国際出願の不備
١		第VII概	国際出願に対する意見
	2.	際予備審査機関がP ない旨を国際事務局	がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 CT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。
		63月又は優先日が	ように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か ら22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 もに、答弁書を提出することができる。
		さらなる選択肢は、	様式PCT/ISA/220を参照すること。
	3	. さらなる詳細は、梯	式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 01.04.2005		
名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員)	2M 9355
日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	岩本勉	
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内	線 3274 ——————

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

第 I 棡 見解の基礎										
1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。										
□ この見解書は、 語による翻訳文を基礎として作成した。 それは国際調査のために提出された P C T 規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。										
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。										
a. タイプ	配列表									
	配列表に関連するテーブル									
b. フォーマット	<b>書面</b>									
	コンピュータ読み取り可能な形式									
c. 提出時期	<b>出願時の国際出願に含まれる</b>									
	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された									
	出顕後に、調査のために、この国際調査機関に提出された									
3.										
4. 補足意見:										
T. MINCHES OF	•									

## 国際調査機関の見解書

第V欄 新規性、進歩性又は それを裏付る文献及び		ついてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 	
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-25	有. 無.
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の <b>範</b> 囲	1-25	_ 有 _ 無
産業上の利用可能性(Ⅰ)	A) 請求の範囲 請求の範囲	1-25	_ 有 _ 無

## 2. 文献及び説明

文献 1: JP 11-111603 A (大日本スクリーン製造株式会社) 1999.04.23 文献 2: JP 11-156278 A (大日本スクリーン製造株式会社) 1999.06.15 文献 3: JP 2001-274082 A (東京エレクトロン株式会社) 2001.10.05

文献 4: JP 2003-303752 A (株式会社日立製作所) 2003.10.24

文献 5: JP 2001-102292 A (東京エレクトロン株式会社) 2001.04.13

## ・請求の範囲1-25

請求の範囲1-25に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-5より進歩性を有しない。文献1及び2には、複数の吐出口を直線上に配置したノズルを備え、基板を鉛直軸回りに回転させた状態で、当該ノズルを基板の外側から中央部に向かって移動させて基板表面に現像液を螺旋状に供給する現像装置が記載されている。また、文献3-5には、細長い帯状に現像液を供給するノズルであって、現像液の温度調整部、濃度調整部、複数の現像液ノズル、リンス液供給ノズル等を備え、これらノズルを基板上で移動して現像液を供給する現像装置が記載されている。

文献1-5に記載の現像装置が、いずれも現像液を供給するという同一の技術に関するものであるから、文献1,2の発明において、文献3-5に記載の各種ノズルを適用して請求の範囲1-25に記載された発明をすることは、当業者が容易になし得たことである。

そして、レジストの種類、およびレジストパターンの線幅等の幾何学的特徴を考慮 して現像液の濃度及び温度を設定することは、当業者にとって自明なことである。